

VERANSTALTUNGEN

Patente, Marken und Designschutz für KMU und Start Ups

Gemeinsam mit den Partnern IHK Erfurt und dem Deutschen Patent- und Markenamt lädt das PATON zu einer kostenfreien Veranstaltung zum Thema **Patente, Marken und Designschutz für KMU und Start Ups** am **8.12.2020, 14.00 Uhr** ein. Geplant ist eine „Hybridveranstaltung“, bei der ein begrenzter Teil der Teilnehmer und Referenten vor Ort in Erfurt sein wird und die anderen Interessenten virtuell teilnehmen können. Wir freuen uns besonders, dass es auch einen Vortrag aus Sicht „eines betroffenen Unternehmens“ zum Thema Schutz von Ideen – Vor- und Nachteile geben wird.

Weitere Infos und die Anmeldemöglichkeit dazu finden Sie in Kürze hier: <https://www.paton.tu-ilmenau.de/>

VERANSTALTUNGEN – RÜCKSCHAU

PIZnet-Aktionswoche „Wertschöpfung mit Ideen- und Innovationschutz“ VIP4SME

Die vierte Aktionswoche VIP4SME in der letzten Septemberwoche 2020 wurde sehr gut angenommen. Startups und KMU haben die Möglichkeit genutzt, sich von Kolleginnen der Abteilung Recherche und Analyse des PATON kostenfrei im Rahmen eines 2-stündigen Interviews den aktuellen Stand und die Möglichkeiten der Nutzung gewerblicher Schutzrechte (Patente/Gebrauchsmuster, Marken, Designs, Software, KnowHow) im eigenen Unternehmen aufzeigen zu lassen.

Dieses Angebot wird es im nächsten Jahr wieder geben.

Darüber hinaus können Unternehmen/Erfinder nach Voranmeldung ganzjährig die Angebote „Eigenrecherche im PATON-Recherchesaal“ bzw. „Begleitete Recherche“

<https://www.paton.tu-ilmenau.de/dienstleistungen/betreute-eigenrecherchen.html>

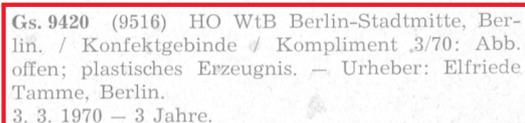
sowie die kostenfreie Erfinderersterberatung durch Thüringer Patentanwälte nutzen

<https://www.paton.tu-ilmenau.de/dienstleistungen/beratung-fuer-erfinder-gruender-und-unternehmen/erfinderberatung-durch-patentanwaelte.html>

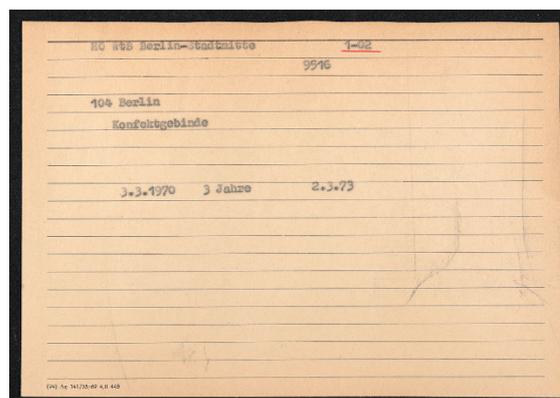
DFG DDR-DESIGN PROJEKT – UPDATE

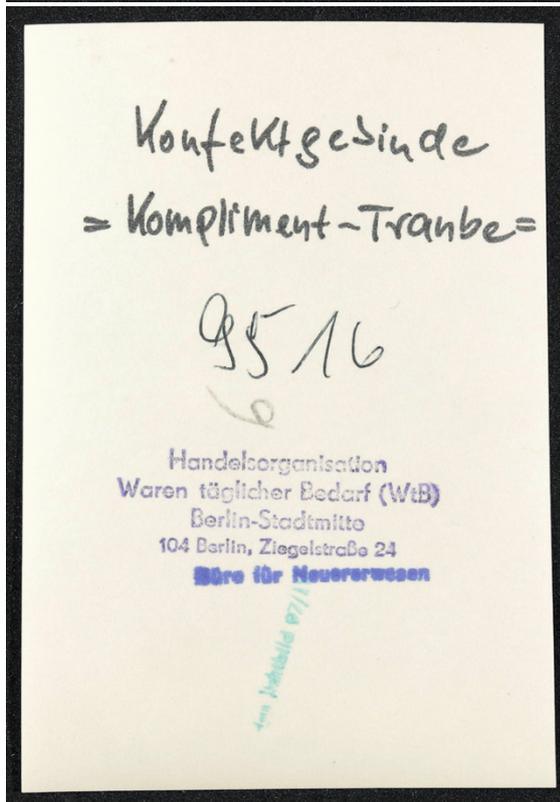
Am 20. Oktober wollen wir uns zum DFG-Projekt "Digitalisierung des DDR-Designs" mit allen Partnern, Unterstützern und Projektbeteiligten zu ersten Projektergebnissen und den Erwartungen und Wünschen der interessierten Kreise austauschen. Auch dieses Treffen wird als Hybridveranstaltung organisiert.

Zu unseren DDR-Design-Beispielen im letzten PATON-Newsletter gab es viel Interesse und Nachfragen – deshalb haben wir hier ein weiteres Design-Beispiel mit dem schönen Namen „Konfektgebände – Kompliment Traube“ beigefügt:



Gs. 9420 (9516) HO WtB Berlin-Stadtmitte, Berlin. / Konfektgebände / Kompliment 3/70: Abb. offen; plastisches Erzeugnis. — Urheber: Elfriede Tamme, Berlin.
3. 3. 1970 — 3 Jahre.





PATENTMANAGEMENT THÜRINGER HOCHSCHULEN

Internationale Erfinderfachmesse iENA 2020

Vom 29.10. bis 1.11.2020 findet dieses Jahr in Nürnberg wieder die iENA, die Internationale Fachmesse Ideen * Erfindungen * Neuheiten (<http://www.iena.de/>) statt.

Auch dieses Jahr werden wieder die Thüringer Wissenschaftserfindungen vom PATON-Patentmanagement Thüringer Hochschulen und die Thüringer Wirtschaftserfindungen von ERiNET auf der Messe präsentiert. Die Thüringer Wissenschafts- und Wirtschaftserfindungen können Sie auf dem Messegelände in Präsenz erkunden. Ob und in welchem Rahmen dieses Jahr die Auszeichnungsveranstaltung stattfindet, wird jedoch erst kurzfristig entschieden. Die gewonnenen Erfindermedaillen werden dennoch auch dieses Jahr an die Thüringer Wissenschafts- und Wirtschaftserfinder übergeben.

Weitere Infos dazu erhalten Sie bei jan-axel.schleicher@tu-ilmenau.de



(Text und Foto PATON-PTH)

VERWERTUNGSANGEBOT THÜRINGER HOCHSCHULTECHNOLOGIEN

Verfahren und Vorrichtung zur Verbesserung der konfokalen Vermessung von Flächen

Bei der optischen Messung der Höhe einer Probe (Profil, Oberfläche) führen die Beschaffenheit der Probe selbst oder anderweitige, sich während der Messung ändernde optische Eigenschaften zu Höhenmessfehlern.

Dieses Problem wird im Stand der Technik selten adressiert. Die wenigen gängigen Lösungen besitzen oft nur eingeschränkte Gültigkeit in verschiedenen Messsituationen oder schränken die Flexibilität des Systems ein.

Mit der Erfindung sollen die durch instationäre Aberrationen verursachten systematischen Fehler bei der Vermessung von Probenoberflächen, einer Höhenmessung, mit hoher Genauigkeit und hoher Geschwindigkeit kompensiert werden.

Das neuartige Verfahren erweitert differentielle Konfokalmikroskope und deren Derivate. Die Höhe der Probe wird dabei über eine differentielle Kennlinie gefunden (Bild). Es kompensiert den vorliegenden Fehler hinsichtlich der Nullstelle der Kennlinie (Probenhöhe) vollständig und hinsichtlich des Teilfehlers des Anstieges der Kennlinie teilweise. Das Verfahren basiert darauf, dass entweder negative Signalteile oder positive Singalanteile um den Ursprung der axialen Koordinate gespiegelt werden und um den Betrag des doppelten vorliegenden Defokus verschoben werden. Dadurch wird eine fehlerkompensierende Punktsymmetrie hergestellt.

Die vorliegende Erfindung ermöglicht exaktere Messungen von technischen Oberflä-

chen mit geneigten Flanken oder Freiformoberflächen. Umgekehrt werden so auch exaktere Messungen von Oberflächen mit einer hohen Verkippung gegenüber der optischen Achse ermöglicht.

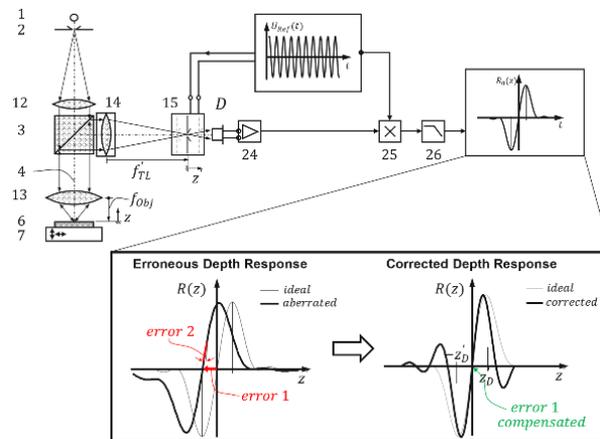


Bild: Prinzipieller Aufbau eines zeit-modulierten differentiellen Konfokalmikroskops mit einer schwingenden Lochblende (15) im Bildgebungsstrahlengang für ein unendlich-korrigiertes Mikroskopobjektiv (13) und anschließende Kompensation von instationären Aberrationen.

SERVICE

Newsletter-Archiv

Ältere Ausgaben des PATON-Newsletters können Sie hier abrufen:

[PATON-Newsletter Archiv](#)